

СВЕДЕНИЯ ОБ ОППОНЕНТЕ

по кандидатской диссертации Рогова Олега Юрьевича
 «Формирование и исследование хиральных фотонных наноструктур методами
 электронной и ионной микроскопии»
 по специальности 01.04.07– «Физика конденсированного состояния».

Фамилия, имя, отчество оппонента	Боргардт Николай Иванович
Дата рождения	28.10.1956
Шифр и наименование специальности, по которым защищена диссертация	01.04.10 - Физика полупроводников
Ученая степень и отрасль науки	Доктор физико-математических наук
Ученое звание	Профессор
Полное наименование организации, являющейся основным местом работы оппонента	Федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования «Национальный исследовательский университет «Московский институт электронной техники»
Почтовый адрес с указанием индекса	124498, Россия, Москва, Зеленоград, Площадь Шокина, д. 1
Занимаемая должность	Заведующий кафедрой общей физики
Телефон	8-499-720-85-58
Адрес электронной почты	niborgardt@miee.ru
Список основных публикаций официального оппонента по теме диссертации в рецензируемых научных изданиях за последние 5 лет	<ol style="list-style-type: none"> 1. N. I. Borgardt, R. L. Volkov, A. V. Rumyantsev, Yu. A. Chaplygin, Simulation of material sputtering with a focused ion beam // Technical Physics Letters.- 2015. Т. 41, №. 6. С. 610–613. 2. N. I. Borgardt, A. V. Rumyantsev, Prediction of surface topography due to finite pixel spacing in FIB milling of rectangular boxes and trenches // Journal of Vacuum Science & Technology B.- 2016. Т. 34, №.6. С. 803 3. Ya. S. Grishina, N. I. Borgardt, R. L. Volkov, D. G. Gromov, S. V. Dubkov, Electron microscopy studies of crystallites in carbon nanopillars grown by low-temperature plasma-enhanced chemical-vapor deposition // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques.- 2017. Т. 11, №.1, С. 226–233. 4. N. I Borgardt, A. V Rumyantsev, R. L Volkov, Y. A. Chaplygin, Sputtering of redeposited material in focused ion beam silicon processing // Materials Research Express.- 2018. Т.5, №.2. С.905-906 5. A. V. Rumyantsev, N. I. Borgardt, R. L. Volkov, Simulation of Redeposited Silicon Sputtering under Focused Ion Beam Irradiation // Journal of Surface

	<p>Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques.-2018. Т. 12, №.3, С. 607–612.</p> <p>6. R. L. Volkov, N. I. Borgardt, D. G. Gromov, S. V. Dubkov, Electron Diffraction Analysis of the Structure of Carbon Nanopillars along the Growth Direction // Journal of Surface Investigation: X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques.- 2018, Т. 12, №.3, С. 473–479.</p> <p>7. Rummyantsev A. V., Borgardt N. I. Prediction of surface topography due to finite pixel spacing in focused ion beam milling of circular holes and trenches //Journal of Vacuum Science & Technology B. - 2018. Т. 36, №. 6, С. 061802.</p>
--	---

Дата: 15.10.2019


Подпись Боргардта Н. И. заверяю,
Начальник отдела кадров





(подпись)

д.ф.-.м.н., Боргардт Н.И.



(подпись)

Заболотный С.В.